

UV露光装置

MODEL: LUV-1000

【2kW 超高圧水銀ランプを使用した露光装置】

平行光を照射し、 $30\sim 40\text{mW}/\text{cm}^2$ の強度で露光します。
マスクガラスを装着してパターン露光も可能です。
露光対象のガラスと照射光の平面出しを自動で行います。

専用PCソフトウェアより制御を行い、シャッターコントローラーから露光操作を行います。



高精度なパターン露光が可能



シャッターコントローラー

仕様

品名	UV EXPOSURE EQUIPMENT
型式	LUV-1000
対応マスクサイズ	材質:ガラス 寸法:127 x 127 [mm] 公差0.5[mm] 厚み:2.3 [mm]
対応サンプルサイズ	材質:ガラス 寸法:100 x 100 [mm] 厚み:0.7 又は1.1 [mm]
マスクとサンプルのギャップ幅	調整幅:0~300 [μ m] 調整分解能:1 [μ m]
光源	超高圧水銀ランプ 2kW 全光束:90,000lm 平均寿命:500時間
放射照度	30~40 [mW/cm ²]
照射面積	有効照射面積:150× 150 [mm]
照射均一性	有効面内にて90 [%] 以上
照射平行度	コリメーションハーフアングル 2.0 [deg] デクリネーションアングル 0.5 [deg]
照射波長範囲	300~500[nm]
管理波長	365 [nm]
露光の管理	別体のシャッターコントローラーに依存 積算露光量、又は露光時間での管理
電源電圧	単相200V 50/60Hz
エア環境	【駆動用 圧縮エアー】 0.6 [MPa] 【冷却用 エアー】 吐出量:4.5 [m ³ /min]以上 ダクト径:φ 125[mm] 【排気用】 ダクト径:φ 125[mm] 【真空ポンプ】 装置に付属
消費電力	40 [A]以下
寸法(W x H x D)	1150 mm(W)×2010 mm(H)×1400 mm(D)
重量	300 [kg]

製品構成

項目	説明	備考
UV露光機 本体		
光源用電源部		本体に装備
排気用ブロアーファン	ダクト付属	本体に装備
無停電電源装置 UPS	PC等のAC100V駆動向け	本体に装備
シャッターコントローラー	ウシオ製	本体に装備
真空ポンプ		
露光マスクガラス		お客様支給
デスクトップPC&モニター		本体に装備

オプション・カスタム

オプション	内容
放射照度変更	減光フィルターの挿入等で30mW/cm ² 以下に落とします
カスタム	内容
遮光シャッターの追加	部分露光ができるように分割式の遮光シャッターを追加します
露光マスク変更	マスクホルダーの寸法を変更します
サンプルサイズ変更	対応するサンプルサイズを変更します
PCソフトウェア変更	表示や機能の変更

PC画面

TSUBOSAKA ELECTRIC

終了 GAP校正 露光準備 ワーク交換 I/Oチェック

- 状態 -

- 非常停止
- エア圧力
- 正面ドア
- マスク吸着
- ワーク吸着
- 球面座吸着
- マスクスライドベース前
- マスクスライドベース後

- UVランプ -

ランプ点灯 自動露光 手動露光

中断 シャッター開閉

ランプ点灯 ランプ安定 ランプ冷却 ランプ異常

シャッター開 シャッター閉 ランプドア 露光中

- GAP -

0 [um]

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 CLEAR



<http://www.tsubosaka.co.jp>

TSUBOSAKA

光学応用機器・計測器の開発・設計・製造

壺坂電機株式会社

〒192-0032

東京都八王子市石川町1683-1

TEL:042-646-1127

FAX:042-646-1834

E-mail:sales@tsubosaka.co.jp